

氏名	田中 博樹 (Tanaka Hiroki)
所属・職名	電子情報科 兼 機械加工科 主任研究員
専門分野	量子エレクトロニクス、レーザー工学、応用光学
主な研究テーマ	<ul style="list-style-type: none"> ○レーザーアブレーション法によるタンパク質フォールディング制御用ナノ粒子の作製 ○マスクレスで化学洗浄が不要なプリント基板配線パターン作製法の開発 ○低コストで高機能な発光サイン用導光板の開発 ○レーザー樹脂溶着の高品質化に関する研究 ○レーザーによる異材樹脂溶着の高品質化に関する研究
研究内容キーワード	レーザー、レーザー加工、光源、輝度、照度、分光、ナノ粒子
技術相談・共同研究・受託研究など可能な技術	<ul style="list-style-type: none"> ○レーザー加工（マーキング、カットイング、樹脂溶着） ○明るさや色の測定 ○分光計測 ○ナノ粒子の創製 ○電子機器等の電磁感受性（EMS）試験
共同研究等に利用可能な装置等	<ul style="list-style-type: none"> ○ファイバーレーザーマーカ：金属へのマーキング、樹脂へのマーキング、金属箔のカットイング ○炭酸ガスレーザー加工機：樹脂へのマーキング、木材へのマーキング、樹脂板のカットイング ○分光光度計 ○マルチチャンネル分光器 ○輝度計 ○照度計 ○EMS 試験機器：静電気試験器、雷サージ試験器、インパルスノイズ試験器、EFT/B 試験器、電源電圧変動試験器 ○電気用品安全法（PSE）適合性検査機器：アース導通試験器、耐電圧・絶縁抵抗試験器、漏洩電流試験器 ○電源高調波・フリッカ測定装置 ○高機能安定化電源

補足説明

技術の紹介

